

MPI MicroPositioner

MPIはバックラッシュの少ない多種多様なマイクロポジショナを取り揃えております。小型なものから高周波/ミリ波測定用のマイクロメータを使った高分解能なマイクロポジショナまでいろいろご用意しております。

統一されたZ移動方向、人間工学に基づいた設計、強力磁気ベースにより安定した高いプローブコンタクトを実現し、優れた測定結果を導き出します。どのプローブ・アームにも対応できるよう設計されているため、アプリケーションによりアームを変更するだけでアプリケーションに応じたプロービングを可能にします。

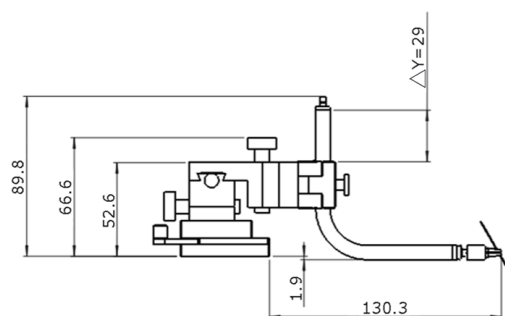
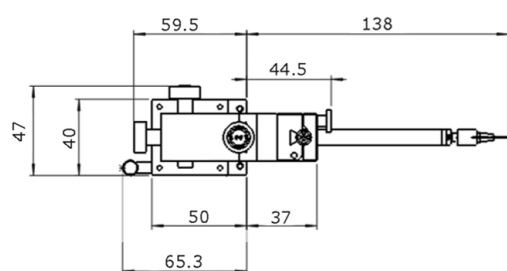
ラインナップがさまざまあることによりオペレータの最も使い慣れている操作性に近いものをご選択いただくことが可能となり、すぐに操作が上達することにつながります。自社設計のMPIマイクロポジショナは品質に妥協することなく設計されており、フル・カーボン・スチールにより安定した高精度なコンタクトを長期間提供することが可能です。

■ MP25 小型マイクロポジショナ

分解能*	< 4 μ m
移動量 (X/Y/Z)	10 / 10 / 10 mm
マイクロメータ分解能 (X/Y/Z)	500 / 500 / 500 μ m
ベース機構	磁気ベース
ベース・ステージ	25 mm
ベース寸法	55 mm x 40 mm
タイプ	左用/右用
対応アプリケーション	IV/CV 同軸、超低電流トリアキシャル測定



寸法 - マイクロポジショナおよびDCアーム/チップ



単位: mm

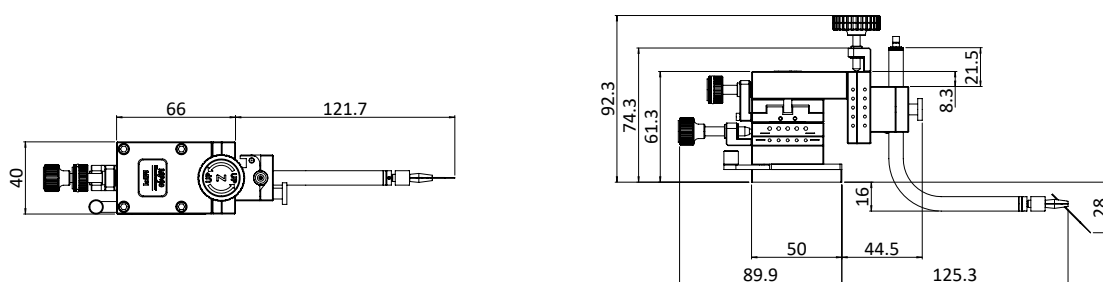
*分解能はオペレータの技量に左右される主観的値。

MP40 汎用マイクロポジショナ

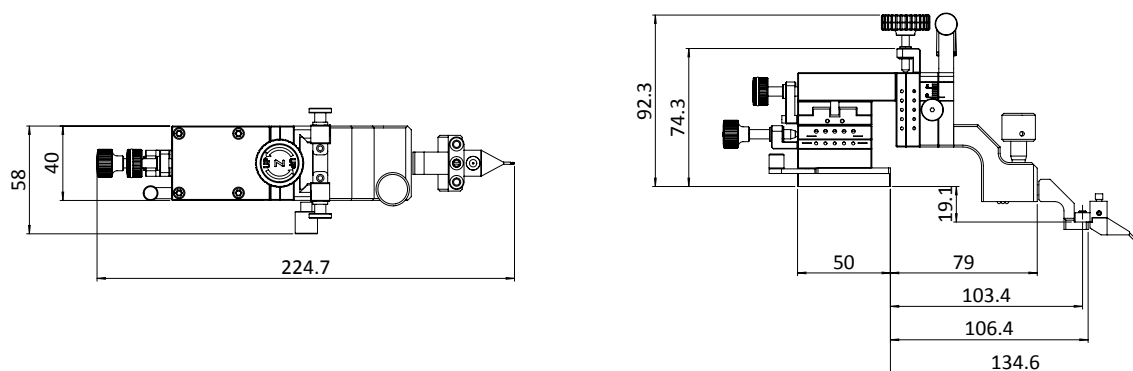
分解能*	< 3 μm
移動量 (X/Y/Z)	13 / 13 / 13 mm
マイクロメータ分解能 (X/Y/Z)	300 / 300 / 300 μm
ベース機構	磁気ベース
ベース・ステージ	40 mm
ベース寸法	65 x 40 mm
タイプ	左右仕様なし
対応アプリケーション	高精度IV/CV 同軸、超低電流トライアキシャルおよび高周波測定



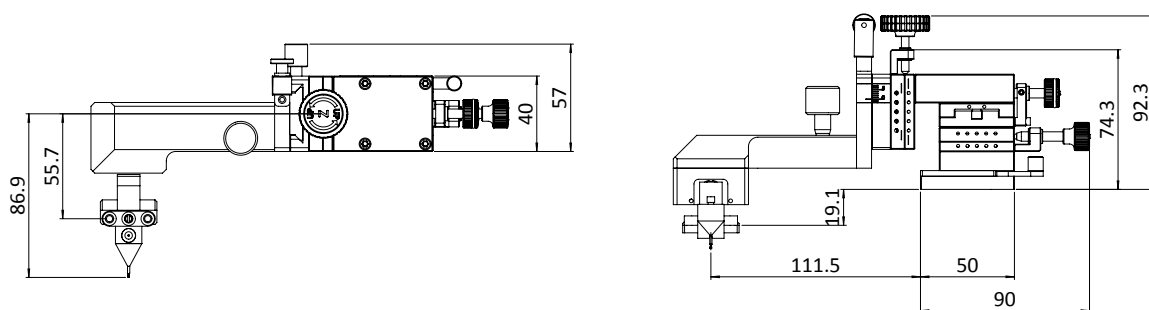
寸法 - マイクロポジショナおよびDCアーム/チップ



寸法 - マイクロポジショナおよびRFアーム(東西)/TITAN™プローブ・ヘッド



寸法 - マイクロポジショナおよびRFアーム(南北)/TITAN™プローブ・ヘッド



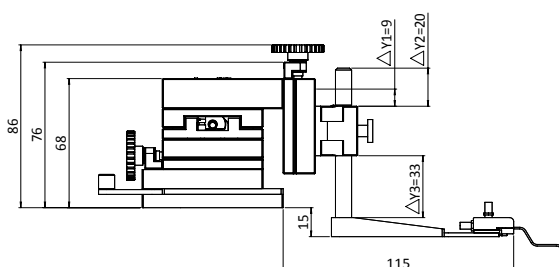
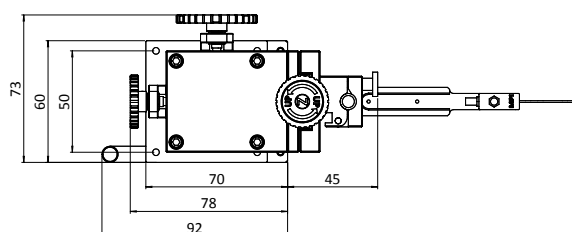
単位: mm

MP50 ケルビン用マイクロポジショナ

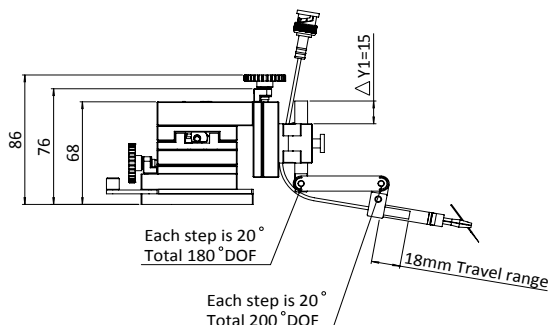
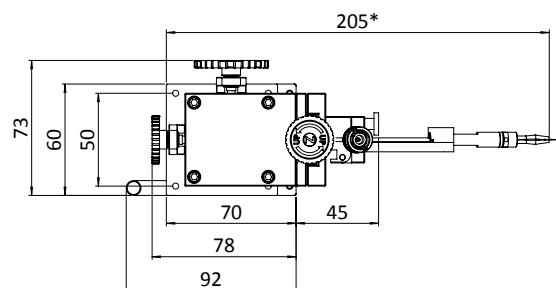
分解能*	< 0.5、< 1 または < 2 μm
移動量 (X/Y/Z)	13 / 13 / 13 mm
マイクロメータ分解能 (X/Y/Z)	125/125/125、250/250/250 または 500/500/500 μm
ベース機構	磁気ベース
ベース・ステージ	50 mm
ベース寸法	86 x 60 mm
タイプ	左用/右用
対応アプリケーション	高精度IV/CV 同軸、超低電流トリアキシャル測定、内部ノードプロービング



寸法 - マイクロポジショナおよびDCアーム/チップ



寸法 - マイクロポジショナおよびフレキシブル・アーム/チップ



*調整した位置により変化する

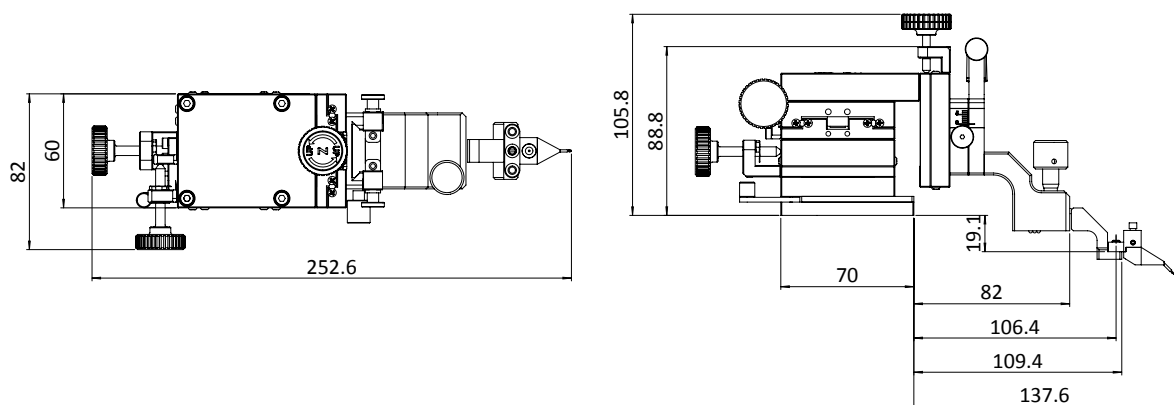
単位: mm

MP60 RFマイクロポジショナ

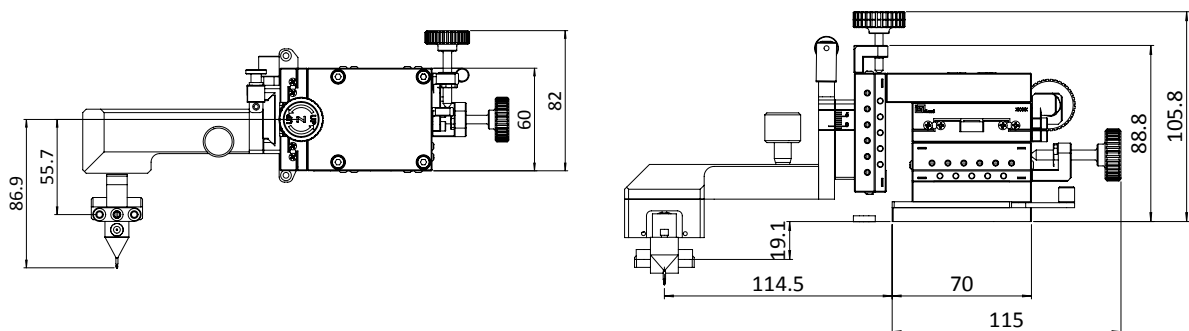
分解能*	< 1 μm または < 2 μm
移動量 (X/Y/Z)	20 / 20 / 13 mm
マイクロメータ分解能 (X/Y/Z)	250 / 250 / 300 または 500 / 500 / 300 μm
ハース機構	磁気ハース
ハース・ステージ	60 mm
ハース寸法	89 x 60 mm
タイプ	左用/右用
対応アプリケーション	高精度高周波測定



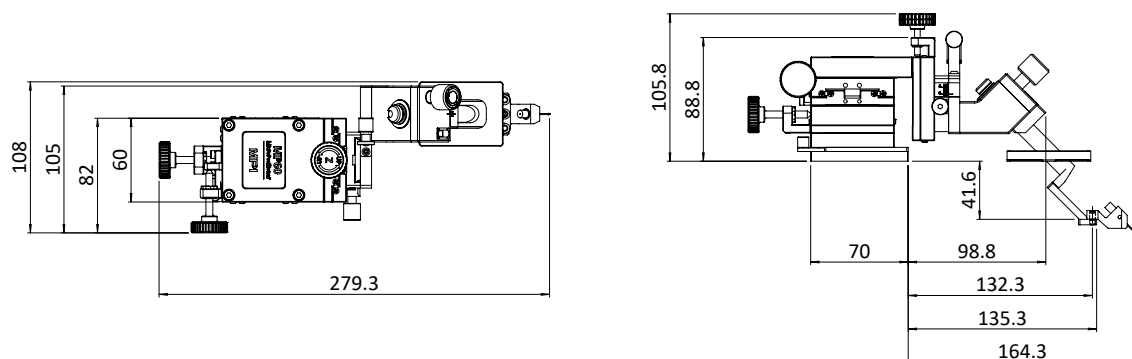
寸法 - マイクロポジショナおよびRFアーム(東西)/TITAN™プローブ・ヘッド



寸法 - マイクロポジショナおよびRFアーム(南北)/TITAN™プローブ・ヘッド



寸法-ShieldEnvironment™ 用RF アーム*(東西)、標準または LTM タイプと TITAN™ プローブ



*アームは MP60 および MP50 マイクロポジショナと一緒に使えます

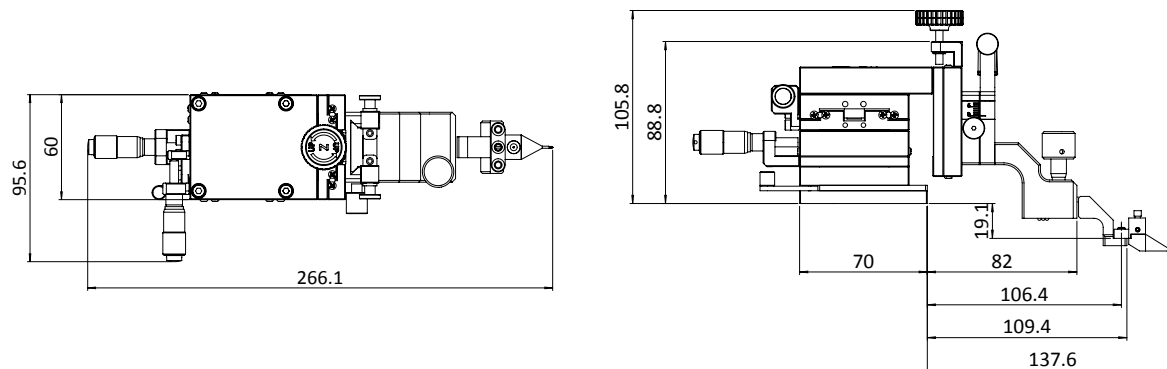
単位: mm

MP60-MR 高精細RFマイクロポジショナ

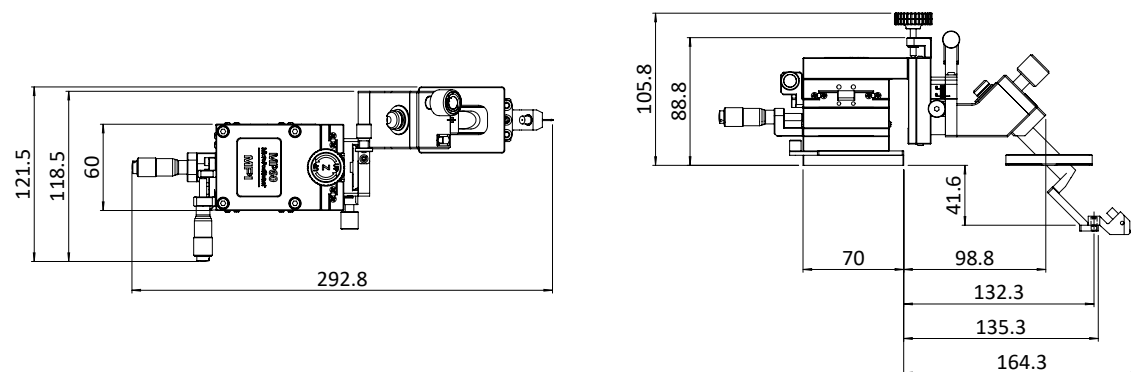
分解能*	< 2 μm
移動量 (X/Y/Z)	13 / 13 / 13 mm
マイクロメータ分解能 (X/Y/Z)	500 / 500 / 300 μm
ハース機構	磁気ハース
ハース・ステージ	60 mm
ハース寸法	89 x 60 mm
タイプ	左用/右用
対応アプリケーション	高精度RF(高周波)測定



寸法 - マイクロポジショナおよびRFアーム(東西)/TITAN™プローブ・ヘッド



寸法-ShieldEnvironment™ 用RF アーム*(東西)、標準または LTM タイプと TITAN™ プローブ



*アームは MP60 および MP50 マイクロポジショナと一緒に使えます

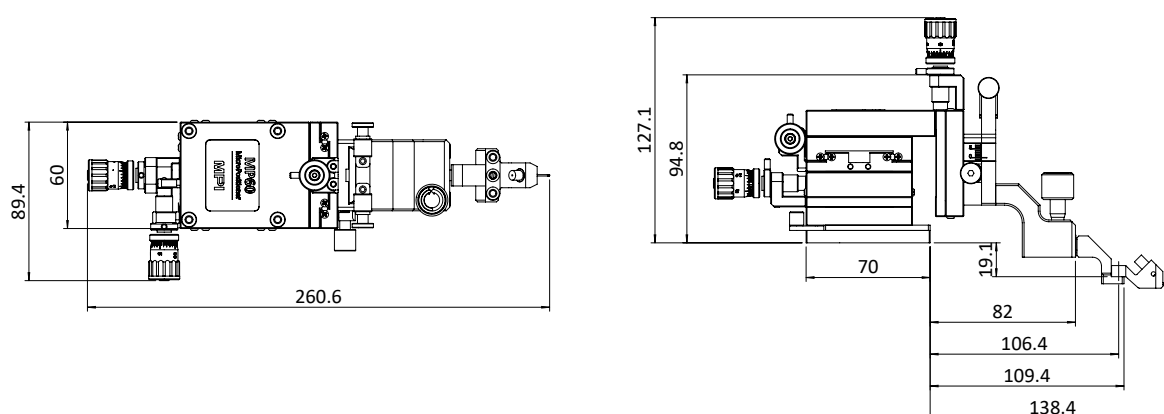
単位: mm

MP60-DM マイクロポジショナ: 高精度型

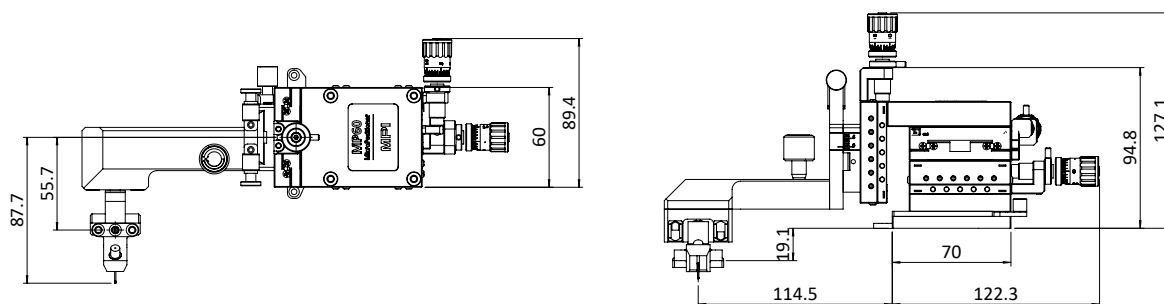
分解能*	< 0.5 μm
移動量 (X/Y/Z)	12.5 / 12.5 / 12.5 mm
マイクロメータ分解能 (X/Y/Z)	25 / 25 / 25 μm
ベース機構	磁気ベース
ベース・ステージ	60 mm
ベース寸法	89 x 60 mm
タイプ	左用/右用
対応アプリケーション	高精度RF(高周波)測定



寸法 - マイクロポジショナおよびRFアーム(東西)/TITAN™プローブ・ヘッド



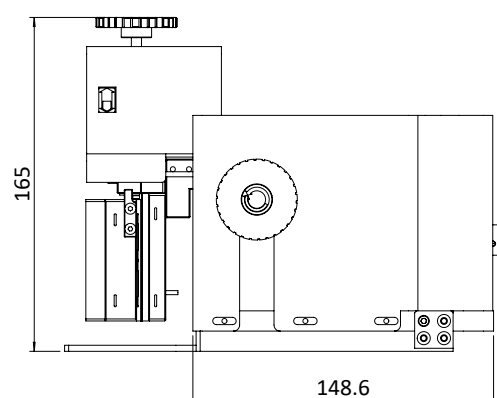
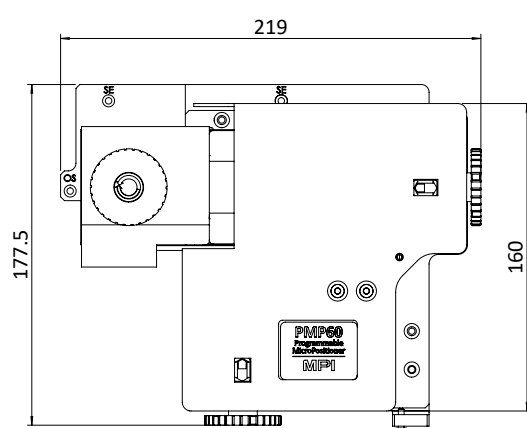
寸法 - マイクロポジショナおよびRFアーム(南北)/TITAN™プローブ・ヘッド



単位: mm

■ PMP60 RFプログラマブル・マイクロポジショナ

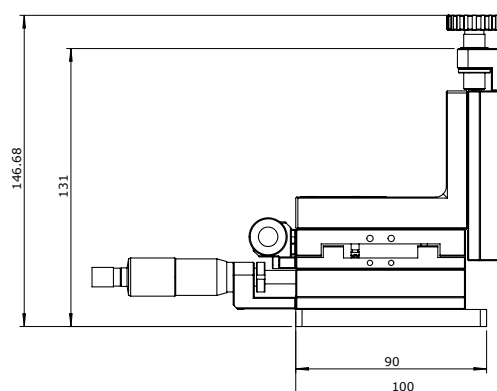
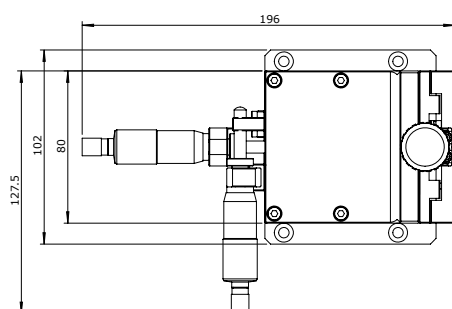
分解能*	< 2 μ m
移動量 (X/Y/Z)	13 / 13 / 13 mm
最小ステップ・サイズ (X/Y/Z)	0.1 μ m
分解能 (X/Y/Z)	0.015 / 0.015 / 0.015 μ m
マイクロメータ分解能 (X/Y/Z)	300 / 300 / 300 μ m
ベース機構	ボルトベース
ベース・ステージ	60 mm
ベース寸法	160 x 149 mm
タイプ	東西南北(最大4台、システム構成、アプリケーションによる)
対応アプリケーション	高精度RF(高周波)測定



単位: mm

■ MP80ミリ波用マイクロポジショナ

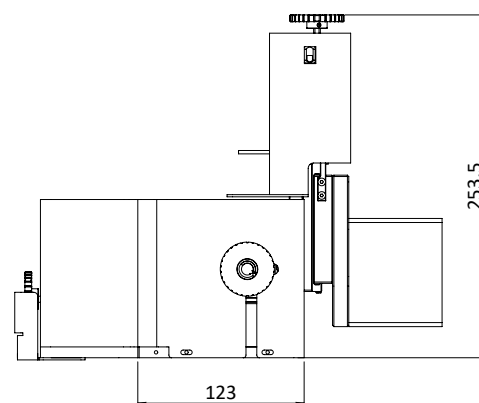
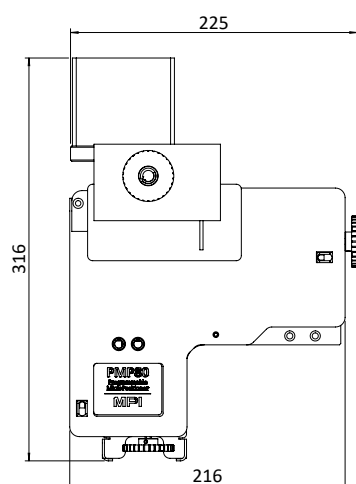
分解能*	< 2 μ m
移動量 (X/Y/Z)	25 / 25 / 15 mm
マイクロメータ分解能 (X/Y/Z)	500 / 500 / 500 μ m
ベース機構	ボルトベース
ベース・ステージ	80 mm
ベース寸法	100 x 80 mm
タイプ	左用/右用
対応アプリケーション	高精度高周波測定、広帯域ミリ波測定



単位: mm

■ PMP80 ミリ波測定用プログラマブル・マイクロポジショナ

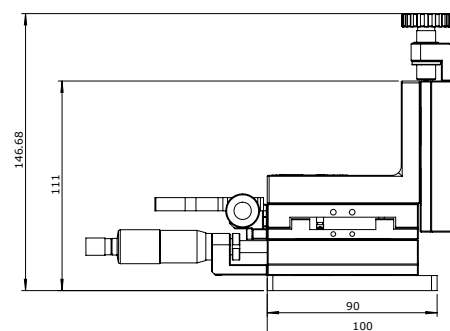
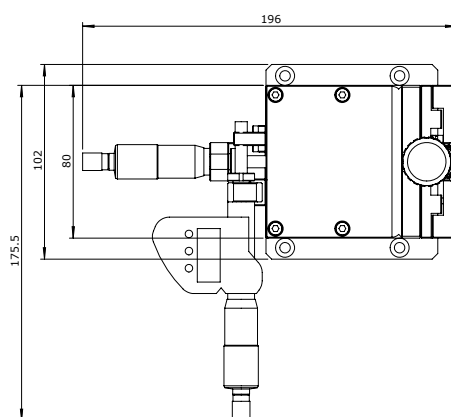
分解能*	< 2 μ m
移動量 (X/Y/Z)	25 / 25 / 10 mm
最小ステップ・サイズ (X/Y/Z)	0.1 μ m
分解能 (X/Y/Z)	0.025 / 0.025 / 0.025 μ m
マイクロメータ分解能 (X/Y/Z)	500 / 500 / 500 μ m
ベース機構	ボルトベース
ベース・ステージ	80 mm
ベース寸法	216 x 193 mm
タイプ	E/W(東/西)またはR/L(右/左)、アーム構成による
対応アプリケーション	高精度、高安定 ミリ波測定



単位: mm

■ MP80-DX マルチラインTRL用マイクロポジショナ

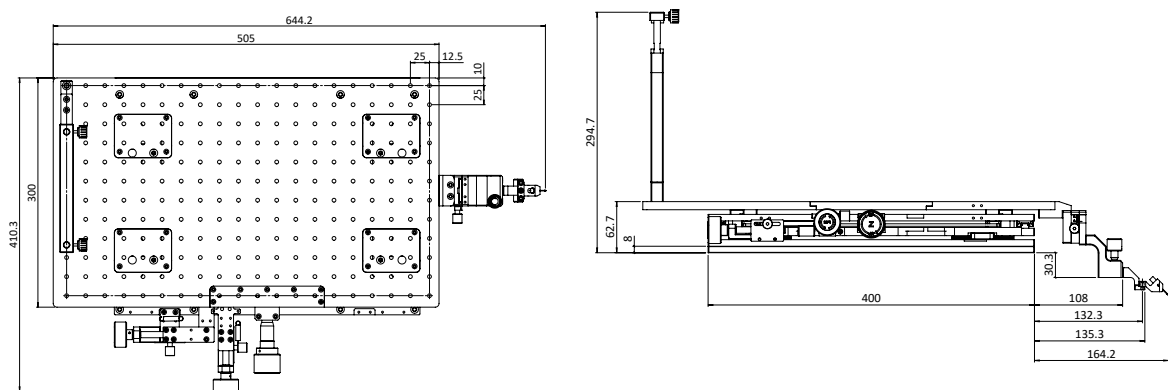
分解能*	< 2 μ m
移動量 (X/Y/Z)	25 / 25 / 15 mm
マイクロメータ分解能 (X/Y/Z)	500 / 500 / 500 μ m
ベース機構	ボルトベース
ベース・ステージ	80 mm
ベース寸法	100 x 80 mm
タイプ	左用/右用
対応アプリケーション	高精度高周波測定、広帯域ミリ波測定 マルチラインTRL測定



単位: mm

MP3X マイクロポジショナ

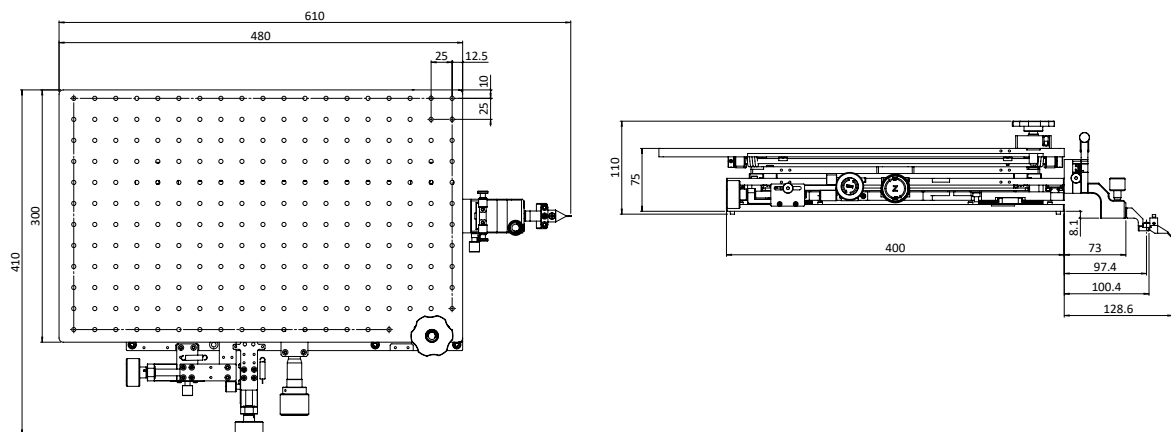
分解能*	< 2 μm
移動範囲 (X/Y/Z)	25 / 25 / 5 mm
スクリュー分解能 (X/Y/Z)	500 / 500 / 167 μm
最大積載量	20 kg
ベース機構	ボルトベース
マウント・プラットフォーム	505 x 300 mm、M6 スクリューホール、25 mm ピッチ
タイプ	左用/右用
アプリケーション	NFおよびロードプル測定



単位: mm

MP4X マイクロポジショナ: プラナリゼーション付き大型タイプ

分解能*	< 2 μm
移動範囲 (X/Y/Z)	25 / 25 / 5 mm
移動範囲 (T)	全体で6 °
分解能 (X/Y/Z):	0.05 / 0.05 / 0.0083 μm
スクリュー分解能 (X/Y/Z)	500 / 500 / 167 μm
スクリュー分解能 (T)	0.16 °/rev.
最大積載量	20 kg
ベース機構	ボルトベース
マウント・プラットフォーム	480 x 300 mm、M6 スクリューホール、25 mm ピッチ
タイプ	左用/右用
アプリケーション	チューナ付きロードプル測定、RF プロブの直接マウント



単位: mm

■ マイクロポジショナ - アプリケーション・マトリックス

アプリケーション / マイクロポジショナ	ステージ (mm)	TPI	IV / CV 同軸	Low-level, IV, Triax	IV/CV/PIV Kelvin	RF	広帯域 mmW	ハイパワー HC / HV
MP25	25	50	●	●	-	-	-	- / ○
MP40	40	85	●	●	●	●	-	● / ●
MP50 MP50-HR	50	50 100	●	●	●	●	-	- / ○
MP60 MP60-HR	60	50 100	○	○	-	●	-	● / ●
MP60-MR	60	50	○	○	-	●	-	○ / ●
MP60-DM	60	1000	○	○	○	●	-	○ / ○
MP80 MP80-DX	80	50	-	-	-	○	●	-
PMP60	60	-	-	-	○	●	-	-
PMP80	80	-	-	-	-	-	●	-
MP3X	400x300	50/150	-	-	-	○	●	-
MP4X	400x300	50/150	-	-	-	○	●	-

*● = 推奨 ○ = 可能

■ マイクロポジショナ - フローブシステム・マトリックス

プローブシステム / マイクロポジショナ	TS50	TS150	TS150-THZ TS200-THZ	TS200 TS300	TS200-SE TS300-SE	TS2000-D TS2000-DP
MP25	●	●	●	●	-	●
MP40	●	●	●	●	●	●
MP50 MP50-HR	○	●	●	●	●	●
MP60 MP60-HR	○	●	●	●	●	●
MP60-MR	○	●	●	●	●	●
MP60-DM	○	●	●	●	●	●
MP80 MP80-DX	-	○	●	●	●	●
PMP60	-	-	-	-	-	○
PMP80	-	-	-	-	-	○
MP3X	-	-	○	●	●	-
MP4X	-	-	○	●	●	-

*● = 推奨 ○ = 可能

プローブシステム / マイクロポジショナ	TS2000-IFE	TS2000-SE TS2000-HP	TS3000 TS3500	TS3000-SE/HP TS3500-SE/HP	TS2500-DP TS2500-RF	TS2500-SE
MP25	○	-	○	-	○	-
MP40	○	●	○	○	●	●
MP50 MP50-HR	●	●	●	●	●	●
MP60 MP60-HR	●	●	●	●	●	●
MP60-MR	●	●	●	●	●	●
MP60-DM	●	●	●	●	●	●
MP80 MP80-DX	●	●	●	●	○	○
PMP60	●	●	●	●	○	○
PMP80	●	●	●	●	-	-
MP3X	●	○	●	●	-	-
MP4X	●	○	●	●	-	-

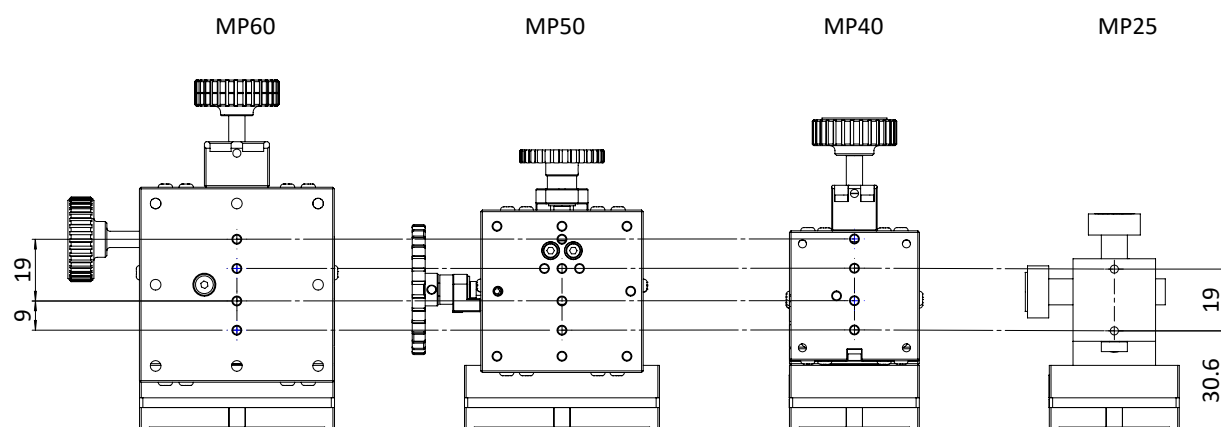
*● = 推奨 ○ = 可能

■ プローブ・アーム - マイクロポジショナ・マトリックス

プローブ・アーム/ マイクロポジショナ	Coax	Coax 10kV	Triax	Triax 3kV	Kelvin	RF	HC	ミ波 専用
MP25	●	-	○	○	-	-	-	◎
MP40	●	●	●	●	●	●	●	◎
MP50 MP50-HR	●	●	●	●	●	●	○	◎
MP60 MP60-HR	○	○	○	○	-	●	●	◎
MP60-MR	○	○	○	○	-	●	●	◎
MP60-DM	○	○	○	○	-	●	●	◎
PMP60	-	-	-	-	○	●	-	◎
MP80 / PMP80 MP80-DX	-	-	-	-	-	○	-	●
MP3X	-	-	-	-	-	○	-	●
MP4X	-	-	-	-	-	○	-	●

*● = 推奨 ○ = 可能 ◎ = DCバイアス

■ MP25からMP60マイクロポジショナのDCプローブアームの取付位置*



*プローブアームは2つのM3 x 8 mmのネジで取り付けます

MPI Accessories

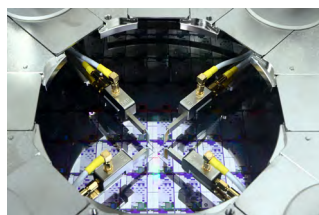
MPIは同軸、トライアキシャル、高周波用プローブ・アーム、高温ケルビン対応プローブ、大電流プローブ(～400 A)など各種アクセサリを幅広く取り揃えております。

ケルビン・アーム

MPIは、幅広いケルビン型プローブアームを提供しています。標準のケルビンホルダは、独自の垂直セルフレベルリング・プローブチップを持ち、DUTに限りなく近い位置で絶縁されています。また、ESDや高感度ノイズ測定に対応したプローブもオプションで用意しています。超低ノイズ、インピーダンスおよびパルスIVの高精度測定に使用いただけます。

ケルビンプローブは、初心者の方でも迅速かつ正確に低インピーダンス測定を行うことができ、4TP接続やパルスIV測定用のグラウンド分割などを簡単に設定することが可能です。

さらに、HT-ケルビンプローブは、300°Cまでの長時間の高温測定に適したプローブです。LTM-Kelvinバージョンは、長期測定に特化した設計で、複数温度での自動テスト、ATMT™を実現します。



フレックス・アーム

MPIのフレキシブル・アームはプローブ・カードと同時に低温でもプロービングを可能とし、アームの角度、長さを自由に調整することが可能で、製品設計、故障解析、設計検証などの用途にご使用いただけます。また小さな被測定物にも安定してプロービングできるよう設計されています。また50Ω終端ではないケーブルオプションによりオシロスコプの接続も簡単に行うことができます。



高周波アーム

RFプローブ・アームは高精度ミツトヨ社製のマイクロメーターがついており上下のラベルが張られており、簡単に便利にプローブの平坦度を出すことができます。工具などは必要なくmm目盛り付の垂直方向の調整機構により素早く簡単に高周波プロービングを可能にします。ケーブルの張力緩和の治具が2個ついており、差動測定の際も安全にケーブルの引き回しを可能とします。



その他アクセサリ

防振機構、防振テーブルは備え付けのパソコンラック、キーボードトレイ、デュアル・モニタスタンド、EMIシールド機構付暗箱などの幅広いオプションからご選択いただけます。

またプローブ・カード・ホルダ、PCBテストホルダ、真空ポンプ、エア・コンプレッサなど測定に必要な完全なソリューションを実現するためにMPIはさまざまなアクセサリをご用意しております。

Direct contact:
 Asia region: ast-asia@mpi-corporation.com
 EMEA region: ast-europe@mpi-corporation.com
 America region: ast-americas@mpi-corporation.com

MPI global presence: for your local support, please find the right contact here:
www.mpi-corporation.com/ast/support/local-support-worldwide

© 2025 Copyright MPI Corporation. All rights reserved.

MPI Global Presence

